【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公表番号】特表2005-518563(P2005-518563A)
【公表日】平成17年6月23日(2005.6.23)
【年通号数】公開・登録公報2005-024
【出願番号】特願2003-570975(P2003-570975)
【国際特許分類第７版】
　Ｇ０３Ｆ　 7/20
　Ｇ０１Ｎ　33/53
　Ｇ０１Ｎ　37/00
// Ｃ１２Ｍ　 1/00
　Ｃ１２Ｎ　15/09
【ＦＩ】
　Ｇ０３Ｆ　 7/20　　５０１
　Ｇ０１Ｎ　33/53　　　Ｄ
　Ｇ０１Ｎ　37/00　　１０２
　Ｃ１２Ｎ　15/00　　　Ｆ
　Ｃ１２Ｍ　 1/00　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成16年9月17日(2004.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも光源と、前記光源からの光で処理するために感光性バイオポリマーが上に配置される基板を受けるのに好適な処理チャンバと、前記光源からの光を前記基板上の選択部位に配向するための割当要素とを備える、感光性バイオポリマーを処理するための装置であって、
　前記割当要素が少なくとも１つのモータ駆動ミラーを含み、前記ミラーは磁場を発生するデバイスの磁極間に配置された回転可能スプールに装着され、前記割当要素が前記ミラーの方向を制御するために前記スプールに結合された調節可能な電源を有することを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記ミラーの方向が、前記基板上の選択された照射部位に対応する予め定められた位置に調節可能であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記割当要素がガルバノミラーであることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ミラーのモータが温度安定性であることを特徴とする請求項１から請求項３の１項に記載の装置。
【請求項５】
　焦点レンズ、好ましくはＦ－θ－レンズが、前記ミラーと前記基板との間の光路内に配置されることを特徴とする請求項１から請求項４の１項に記載の装置。

【請求項６】
前記光源が紫外光源であることを特徴とする請求項１から請求項５の１項に記載の装置。
【請求項７】
前記紫外光源が、３４０～３９０ｎｍの範囲、好ましくはほぼ３５０ｎｍで作動することを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項８】
前記紫外光源が、周波数トレブルされたＮｄ：ＹＡＧレーザであることを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
少なくとも光源と、前記光源からの光で処理するために感光性バイオポリマーが上に配置される基板を受けるのに好適な処理チャンバと、前記光源からの光を前記基板上の選択部位に配向するための割当部材とを用いる、感光性バイオポリマーを処理するための方法であって、
前記割当部材の使用のために、磁場を発生するデバイスの磁極間に配置された回転可能スプールに装着された少なくとも１つのモータ駆動ミラーから作られ、前記ミラーの方向が調節可能な電源を前記スプールに結合することにより制御されることを特徴とする方法。
【請求項１０】
前記ミラーの方向が前記基板上の選択された照射部位に対応する予め定められた位置に調節可能であることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記ミラーのモータの温度が使用中に安定していることを特徴とする請求項９又は請求項１０に記載の方法。